

Содержание

Методология комплексной технологической оптимизации параметров СВЧ-приборов на основе гетероструктур Гудков А.Г.	5
Анализ сверхширокополосных отражательных фильтров с учетом реальных свойств микрополосковых линий Чернышев С.Л., Йон Лю	26
Коммутационные 3D MID-технологии для формирования трехмерных электронных устройств Кондрашин А.А., Лямин А.Н., Слепцов В.В.	32
Разработка алгоритма управления процессом абразивной доводки свободным абразивом по технологическим факторам Назаров Н.Г., Руденко Н.Р.	42